



# SGC-S1700 SERIES

光学薄膜用蒸着装置

Vapor Deposition Equipment for Optical Thin Films

樹脂基板への成膜に最適! 大量生産を高次元で実現

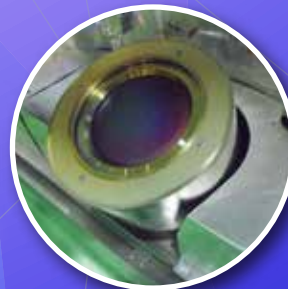
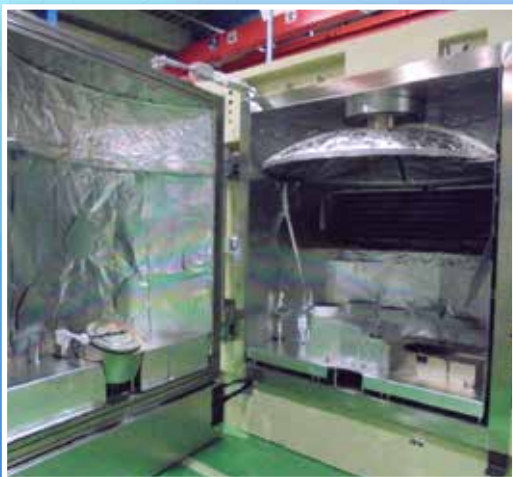
Ideal for film formation on resin substrates! Realizes mass production at high level

AR-coating-specific standard machine,  
incorporating all the technologies of Sapio 1300  
while assuring enhanced cost performance



※パネルはオプションです  
Panel is optional

Sapio1300のテクノロジーを盛り込みつつ  
コストパフォーマンスに優れた  
ARコート専用スタンダードマシン



RFイオンソース、光学モニター、反転パレット  
など多彩な仕様選択が可能

Selectable from a variety of specifications such as; RF ion source,  
Optical monitor and Inverting pallet

# SGC-S1700 SERIES

光学薄膜用蒸着装置  
Vapor Deposition Equipment for Optical Thin Films

## 樹脂基板への成膜に最適! 大量生産を高次元で実現

Ideal for film formation on resin substrates! Realizes mass production at high level

### 【特長・オプション等】

1. 高効率排気システムの採用により、 $\phi 1,300$ 蒸着装置と比較し  
成膜処理時間は+10%程度
2. 1バッチあたり基板収納数は $\phi 1,300$ 蒸着装置の2倍以上
3. 設置面積の省スペース化、全高を抑えたコンパクト設計

### 【Features/ Options】

1. Through the adoption of high efficiency exhaust system, compared with  $\phi 1,300$  vapor deposition equipment, the coating treatment time only increases by about 10%.
2. The number of stored substrates per batch is twice or more of  $\phi 1,300$  deposition equipment.
3. Space saving in the installation area, compact design with reduced overall height.

### 【用途・応用例】

樹脂基板への反射防止膜形成  
光学ミラー

### 【Applications】

Anti-reflection film formation on resin substrate  
Optical mirror

### 概略仕様 Specifications

処理方式 Processing method	バッチ式 Batch type
排気ポンプ Exhaust pump	26インチDP×2+RP+MBP+マイスナートラップ 26 inches DP x 2 + RP + MBP + Meissner trap
設置寸法 Installation dimensions	W4,800mm×D7,600mm×H3,100mm W4,800mm×D7,600mm×H3,100mm
装置重量 Equipment weight	9,500kg 9,500kg
電源容量 Power supply capacity	AC200V(3 $\phi$ ) / 約135kVA AC 200 V (3 $\phi$ ) / about 135 kVA
真空槽サイズ Vacuum tank size	$\phi 1,700$ mm $\phi 1,700$ mm

### 標準搭載 Standard installation

#### 水晶モニター COAT LEADER

Crystal monitor COAT LEADER



当社が長年培ってきた水晶デバイス製造装置の技術を生かし、ネットワークアナライザによる周波数測定方式を採用することで、高精度な膜厚監視、レート制御が可能となっております。

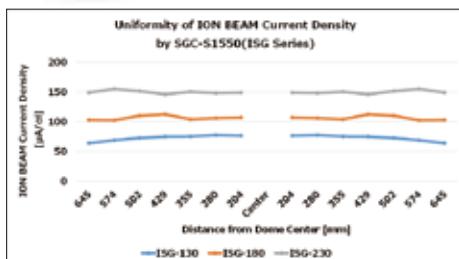
Taking advantage of the technology of quartz device manufacturing equipment that has been cultivated for many years by our company, the accuracy of this system has been significantly improved compared to the conventional measurement method by adopting the frequency measurement method with a network analyzer.

#### 高出力RFイオンソース ISGシリーズ

High power RF ion source ISG series



広範囲で安定した放電を可能にし、光学フィルターのノンシフト膜から樹脂基板への密着性改善まで様々な用途でご使用いただけます。



A wide range of stable discharges is possible, and it can be used in a variety of applications from non-shift films of optical filters to adhesion improvement to resin substrates.



株式会社 昭和真空  
SHOWA SHINKU CO., LTD.

ご質問・詳細につきましては、  
営業部までお気軽にお問合せください。

お問合せ先【営業部】

本社・相模原工場  
〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名3062-10

TEL. 042-764-0370

FAX. 042-764-0377

E-mail. sales-pamphlet@showashinku.co.jp

<https://www.showashinku.co.jp/>

昭和真空

検索

Inquiry [Sales Dep.]

HQ and Sagami-hara Plant

3062-10 Tana, Chuo-ku, Sagami-hara-city, Kanagawa 252-0244 Japan

TEL:+81-42-764-0370 FAX:+81-42-764-0377

本製品は、外国為替並びに外国貿易管理法の規定により、戦略物資等輸出規制品に該当する場合があります。従って、日本国外に該当品を持ち出す際は、日本国政府への輸出許可申請等、必要な手続きをお取りください。

This product may be applicable to export control products such as strategic raw materials which are regulated by the Foreign Exchange and Foreign Trade Control Law. Accordingly when you bring out the applicable products outside Japan, you should take a necessary action such as application of an export permit to the Government of Japan.

Web site 製品情報ページ

真空中で特定の基板に薄膜を形成させる装置を主とした、真空蒸着装置やスパッタリング装置等の真空技術応用装置(真空装置)を製造販売しております。

<https://www.showashinku.co.jp/product/>



新しい成膜方法をお考えのお客様は、ぜひ当社へご相談ください!

※本仕様・外観については、改良のため予告なく変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

If you are looking for new film coating technology, Please ask our company!

\* For the improvement of the product, please understand in advance that the specifications and external views are subject to change without prior notice.